

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第6部門第2区分  
 【発行日】平成17年10月20日(2005.10.20)

【公開番号】特開2004-101831(P2004-101831A)  
 【公開日】平成16年4月2日(2004.4.2)  
 【年通号数】公開・登録公報2004-013  
 【出願番号】特願2002-263033(P2002-263033)  
 【国際特許分類第7版】

G 0 2 B 21/00

G 0 1 B 11/02

【F I】

G 0 2 B 21/00

G 0 1 B 11/02 Z

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月17日(2005.6.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

光源からの光を試料に対して集束させて該試料からの反射光を取り込む対物レンズと、前記光の光軸方向に沿って前記対物レンズの集光位置と前記試料の位置を相対的に移動させる移動機構と、

前記対物レンズの集光位置と共役な位置に配置される共焦点絞りと、

この共焦点絞りを通過する光の強度を検出する光検出器と、

前記対物レンズの集光位置と前記試料との相対位置を検出する測定手段と、

前記対物レンズの集光位置と前記試料の相対位置を変化させ、前記光検出器で検出した光強度の最大光強度値を含む複数の光強度情報と前記測定手段で検出した位置情報とに基づいて光強度情報が示す変化曲線の最大値と、それを与える相対位置を推定し、この推定した光強度の最大値と相対位置を、反射輝度情報と高さ情報として共焦点画像を生成する処理制御手段と

を具備することを特徴とする共焦点顕微鏡。

【請求項2】

前記測定手段は、前記対物レンズの光軸上に配置すること

を特徴とする請求項1記載の共焦点顕微鏡。

【請求項3】

前記測定手段は、前記対物レンズの光軸に対して略対称に配置すること

を特徴とする請求項1記載の共焦点顕微鏡。

【請求項4】

前記測定手段は、ガラススケール又は、レーザ干渉計で構成すること

を特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の共焦点顕微鏡。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 【 0 0 1 7 】

また、この発明は、前記測定手段を、対物レンズの光軸上に配置するように構成した。これによれば、簡易な構成を実現したうえで、対物レンズの集光位置と試料との相対位置を高精度に検出することが可能となる。

また、前記測定手段を、前記対物レンズの光軸に対して略対称に配置するように構成した

。

また、前記測定手段は、ガラススケール又は、レーザ干渉計で構成するようにした。